

レーザー顕微鏡

型式：エビデント株式会社
OLS5100

仕様：

- レーザー光源 405nm
- 観察機能 微分干渉観察有り
- 最大測定高さ 200mm
- XY ステージ 300mm×300m
- ステージ駆動 電動



機器の概要：

サンプルを高解像度・高コントラストの三次元データに変換し、短時間でサブミクロン ($0.1\mu\text{m}$) オーダーの観察・測定が可能な顕微鏡です。半導体製品におけるレジストの膜厚やめっき（表面処理）製品における表面粗さなどが非接触かつ簡便に測定できます。

機器の用途：品質管理（レジストの膜厚測定、めっき製品の表面粗さ評価等）

担当室：ものづくり室

導入年度：令和4年度



公益財団法人 JKA 補助事業

この物件は競輪の補助を受けて取得しました。